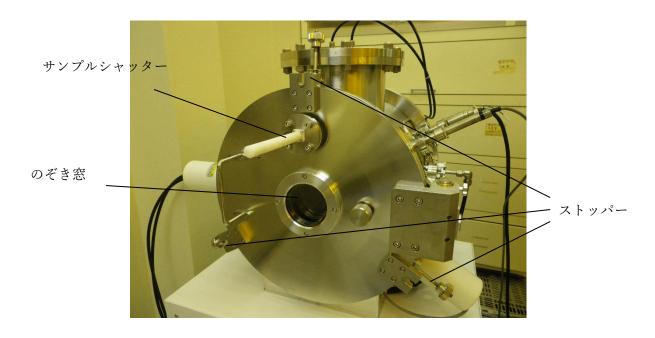
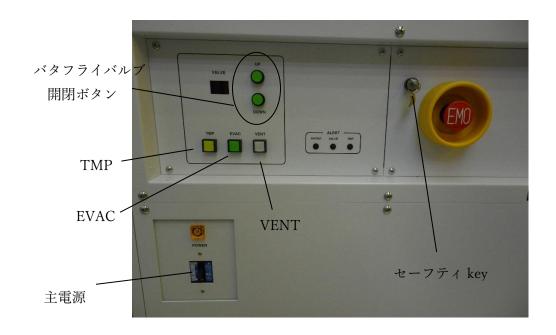
電子ビーム真空蒸着装置 チャンバー 全体図



電子ビーム真空蒸着装置 排気系 全体図



●サンプルセット

使用しない期間はチャンバー内を真空に引いておくこと!

3箇所のストッパーを外し、VENTを押して大気開放する.

サンプルシャッターを開けて扉を開ける.

サンプルをローディングし、扉を閉め、3箇所のストッパーを締める.

サンプルシャッターを閉じる.

EVAC を押して真空引きをする.(VALVEO→15 になればよい)

<サンプルと蒸着源の取り付け>

サンプル

- 1. サンプルホルダーを外す.
- 2. サンプルをテープで固定する.

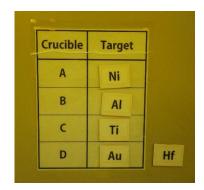
テープ : 誘電体テープ

サイズ : 2,3mm 幅にカットして使用

- 3. サンプルホルダーを元に戻す.
 - ※ 必ず奥まで差し込むこと.

蒸着源

- 1. 所定のハースライナーに蒸着源を入れる.
 - ※ 蒸着源は、EB装置隣の棚の中で管理.
 - ※ 分量は、ハースの8,9割(溶けて液状になったときの量). のぞき窓から見たとき、蒸着源の液面が見える程度にする.
- 2. 4連のハースライナーホルダーに固定する.
 - ※ ホルダー (A~D) の種類は EB 装置本体側面の インジゲーターを参照.



●立ち上げ(続けてやる場合、るつぼの変更を忘れないこと) 真空計(上2段)でチャンバー内真空度の確認、メモする(2~4*10⁻⁴[Pa]くらいが目安) 最上段右 ダイヤルで FILM 1~6 を選択

Next で条件確認

Program で条件確認

MAIN ブレーカーON

[ここに入力]

EGUN ブレーカーON

MAGPower ON

EGUN SUPLLY スイッチ ON(緑)

●蒸着レートの調節

FILAMENT ダイヤルを 2 メモリくらいまで回す

MANETCONT CURRENT ダイヤルを回し、各材料の電流値に調節(ログで確認)

Ti:1.02[A], Au:1.01[A], Ni:1.06[A] *電子の当たる位置次第で調整 ※SWEEP はずっとゼロ

FILAMENT を 10~15A にする(2A/2min でゆっくり上げる)

蒸着源表面が液面になってきたら、のぞき窓を閉める*覗くときはサングラスをつけること 蒸着中の真空度をメモする

	Ti	Au	Ni
$Rate[\mathring{A}/s]$	0.1~0.2	0.1~0.2	0.1~0.2
FILAMENT[A]	13	14	14
HIGH VOLTAGE[kV]	5	5	5
EMISSION[mA]	25	65~80	65

●蒸着

レート調整終了後

シャッターを開け、すぐに経過時間の Zero ボタンを押す(蒸着開始)

(Au の場合、エミッション電流が大きく針が振れやすいため、こまめに調節が必要)

目標の膜厚に達したらシャッターを閉じる

蒸着時間、膜厚を確認、メモする

●立ち下げ

FILAMENT を 12A まで下げる(5min キープ)

2A/2min で緩やかに下げる

OA になったら MAGCONT CURRENT ダイヤルを回しゆっくり下げる

EGUNPower スイッチ OFF

MAGPower トグル OFF

[ここに入力]

EGUN ブレーカーOFF MAIN ブレーカーOFF 記録簿に記入し終了

完全に冷却するまで15分から20分程度そのままにしておく.

*冷却が不十分だと、大気開放したときにフィラメントが酸化してしまう. 次に電流を流したとき不純物が飛び、チャンバー内を汚してしまうので、必ず冷却すること

●サンプル取り出し

3箇所のストッパーを外し、VENTを押して大気開放する.

サンプルシャッターを開けて扉を開ける.

サンプルを取り出し、窓を工業用エタノールをつけたベムコットで拭く

扉を閉め、3箇所のストッパーを締める.

EVAC を押して真空引きをする.(VALVE0→15 になればよい)